



ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク

認 定 証

ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクは、
下記の組織を審査しました。

英弘精機株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

ここに本組織が、以下の認知された国際規格に基づき、認定されたことを証します。

ISO/IEC 17025:2017

本認定により、以下の分野において、関連する認定範囲付属書の技術的能力が確認されました。

機械的校正、光学的校正 (詳細は付属書に記述)

適合性評価活動に対する認定資格は、本認定証内で言及された住所のみを対象とし、関連する認定範囲で特定された活動のみに適用されます。
本認定は、上記規格の認定を管理する認定機関の規定に従って授与され、本組織はその規定を遵守することをここに誓約します。

PJLA

トレーシー サーツェン
プレジデント

Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325, Troy, Michigan 48084

初回認定日
2013年5月8日

発行日
2025年6月13日

認定証有効期限
2027年7月31日

認定番号
74158

認定証番号
L25-447

この認定証の有効性は、持続された認定に基づく継続審査を通して維持されています。
PJLAウェブサイト (www.pjllabs.com)でご確認いただけます

尚、本認定証は日本語翻訳版であり、英文の認定証を正式のものとしします。



認定証付属書

英弘精機株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

秋山 明仁 Tel: 03-3469-6711

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

校正分野	測定機器、数量 又はゲージ	範囲（及び仕様）	不確かさとして 表現されたCMC(±)	使用された校正 機器及び基準、規格	使用された校正測定 方法又は手順	活動 場所
機械的校正	*回転粘度計LV型 スピンドル61タイプ	6 mPa・s - 6 000 mPa・s	41 mPa・s	JISZ8809に基づく 粘度計校正用標準液	JISZ8803 9項に基づく 「回転粘度計校正作業 指示書(LM-03)」	F
	*回転粘度計LV型 スピンドル62タイプ	30 mPa・s - 30 000 mPa・s	200 mPa・s	JS500 JS1000		F
	*回転粘度計LV型 スピンドル63タイプ	120 mPa・s - 120 000 mPa・s	820 mPa・s	JS2000 JS14000		F
	*回転粘度計LV型 スピンドル64タイプ	600 mPa・s - 600 000 mPa・s	4 100 mPa・s	JS52000 JS160000		F
	*回転粘度計RV型 スピンドル02タイプ	40 mPa・s - 40 000 mPa・s	300 mPa・s	B型回転粘度計		F
	*回転粘度計RV型 スピンドル03タイプ	100 mPa・s - 100 000 mPa・s	750 mPa・s			F
	*回転粘度計RV型 スピンドル04タイプ	200 mPa・s - 200 000 mPa・s	1 500 mPa・s			F
	*回転粘度計RV型 スピンドル05タイプ	400 mPa・s - 400 000 mPa・s	3 000 mPa・s			F
	*回転粘度計RV型 スピンドル06タイプ	1 000 mPa・s - 1 000 000 mPa・s	7 500 mPa・s			F
	*回転粘度計HA型 スピンドル02タイプ	80 mPa・s - 80 000 mPa・s	2 000 mPa・s			F
	*回転粘度計HA型 スピンドル03タイプ	200 mPa・s - 200 000 mPa・s	4 900 mPa・s			F
	*回転粘度計HA型 スピンドル04タイプ	400 mPa・s - 400 000 mPa・s	9 800 mPa・s			F



認定証付属書

英弘精機株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

秋山 明仁 Tel: 03-3469-6711

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

校正分野	測定機器、数量 又はゲージ	範囲（及び仕様）	不確かさとして 表現されたCMC(±)	使用された校正 機器及び基準、規格	使用された校正測定 方法又は手順	活動 場所
機械的校正	*回転粘度計HA型 スピンドル05タイプ	800 mPa・s - 800 000 mPa・s	20 000 mPa・s	JISZ8809に基づく 粘度計校正用標準液	JISZ8803 9項に基づく 「回転粘度計校正作業 指示書(LM-03)」	F
	*回転粘度計HA型 スピンドル06タイプ	2 000 mPa・s - 2 000 000 mPa・s	49 000 mPa・s	JS500 JS1000		F
	*回転粘度計HB型 スピンドル02タイプ	320 mPa・s - 320 000 mPa・s	8 600 mPa・s	JS2000 JS14000		F
	*回転粘度計HB型 スピンドル03タイプ	800 mPa・s - 800 000 mPa・s	20 000 mPa・s	JS52000 JS160000		F
	*回転粘度計HB型 スピンドル04タイプ	1 600 mPa・s - 1 600 000 mPa・s	39 000 mPa・s	B型回転粘度計		F
	*回転粘度計HB型 スピンドル05タイプ	3 200 mPa・s - 3 200 000 mPa・s	78 000 mPa・s			F
	*回転粘度計HB型 スピンドル06タイプ	8 000 mPa・s - 8 000 000 mPa・s	200 000 mPa・s			F



認定証付属書

英弘精機株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

秋山 明仁 Tel: 03-3469-6711

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

校正分野	測定機器、数量 又はゲージ	範囲 (及び仕様)	不確かさとして 表現されたCMC(±)	使用された校正 機器及び基準、規格	使用された校正測定 方法又は手順	活動 場所
光学的校正	直達日射計(屋外校正) ISO9060:2018 Class A	700 W/m ² - 1 200 W/m ²	0.47 %(無単位)	標準直達日射計(MS-57) データローガー(CR1000X)	WMO-No. 8:2018及び ISO9059:1990に基づく 日射計校正作業指示書 (2項)(LM-10)	F
	直達日射計(屋内校正) ISO9060:2018 Class A ^F	700 W/m ² - 1 200 W/m ²	0.45 %(無単位)	標準直達日射計(MS-57) デジタルマルチメータ (34401A)	WMO-No. 8:2018 及び ISO9847:2023 に基づく 直達日射計屋内校正作業 指示書(2 項)(LM-10A)	F
	全天日射計 ISO9060:2018 Class A	700 W/m ² - 1 400 W/m ²	0.49 %(無単位)	標準全天日射計 (MS-802) 及び(MS-80) デジタルマルチメータ (34401A)	WMO-No. 8:2018 及び ISO9847:2023 に基づく 日射計校正作業指示書(3 項)(LM-10)	F
	全天日射計 ISO9060:2018 Class B	700 W/m ² - 1 400 W/m ²	1.0 %(無単位)	標準全天日射計(MS-60) デジタルマルチメータ (34401A)	WMO-No. 8:2018 及び ISO9847:2023 に基づく 日射計校正作業指示書(3 項)(LM-10)	F
	全天日射計 ISO9060:2018 Class C	700 W/m ² - 1 400 W/m ²	1.1 %(無単位)	標準全天日射計(MS-40) デジタルマルチメータ (34401A)	WMO-No. 8:2018 及び ISO9847:2023 に基づく 日射計校正作業指示書(3 項)(LM-10)	F
	小型日射計 (ML-01)、(ML-02) ISO9060:2018 Class C	700 W/m ² - 1 400 W/m ²	1.5 %(無単位)	標準小型日射計(ML-01) デジタルマルチメータ (34401A)	WMO-No. 8:2018 及び ISO9847:2023 に基づく 日射計校正作業指示書(3 項)(LM-10)	F



認定証付属書

英弘精機株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

秋山 明仁 Tel: 03-3469-6711

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

1. この認定範囲を含む校正に対して記載されたCMC(校正測定能力)は、ほぼ理想的な条件下でほぼ理想的な機器をおおよそ定められた方法で校正している試験所であれば、達成しうる最小測定不確かさを表している。それは、包含係数 $k=2$ を用いて95%の信頼水準で表される。校正されている機器の能力や性能及び校正に関連する条件は、適度にある程度理想から逸脱しうるので、試験所が行っている特定の校正に関する実際の測定不確かさは、通常同じ校正に対するCMCより大きい。
2. 校正を認定する場合、校正機関の校正能力の範囲は校正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小値から最大値に起因される。従って、校正範囲の最低下限は校正機関が入手できる最低到達可能値でなければならない。標準がない場合、手順や方法によって校正された0(ゼロ)の値を検証することによって、“0点は校正ではない”とする定義を除けば、校正方法は手順に起因する。ただし、この場合、0点の校正が全くできないとする定義は成立しないこともある。
3. 活動場所(コード-活動場所)
F - 恒久的施設